ZrO/W(100)表面修飾型電子源の S-K チャートによる評価

Characterization of ZrO/W(100) Schottky Emitters using S-K chart

中川 晴香[†] 真鍋 美乃里^{††} 川久保 貴史^{††}
 Haruka Nakagawa[†] Minori Manabe ^{††} Takashi Kawakubo^{††}
 [†]香川高専 電子情報通信工学専攻 ^{††}香川高専 通信ネットワーク工学科

1 はじめに

電子源とは、真空中に電子を放出するデバイス で、電子顕微鏡や電子線描画装置等の電子ビーム を扱う装置に用いられる. その中で, ZrO/W(100) 表面修飾型電子源とは、針状に加工したタングス テン線材の先端をジルコニウムと酸素で修飾した 電子源である.電子源の重要な特性の一つである 仕事関数に着目すると、 タングステンは金属とし ては比較的仕事関数が高く、電子放射し難い材料 である.しかし、ジルコニウムと酸素で修飾する ことで、タングステン(100)面の仕事関数が選択的 に低下する性質を利用し, 高輝度な電子源として 実用化されている. タングステン(100)面の仕事関 数低下のメカニズムについては完全には明らかに なっていないが、修飾時の表面組成や原子配列に よるものであると考えられ、ジルコニウム以外の 第3族や第4族の金属と酸素による修飾でも起こ ることが報告されている. 回また、タングステン の他にも、モリブデン(100)面においても修飾によ る仕事関数低下が報告されている. [2]

仕事関数の算出には、Fowler-Nordheimの式を変 形した F-N プロットが広く用いられている.これ は電子源を電界放射モードで電子放射させたとき の、印加電圧と放射電流の関係から作成するグラ フで、このグラフのプロット点から得られる直線 の傾き成分から、電子源の仕事関数を算出するこ とができる.

しかし,これまで ZrO/W(100)電子源を超える高 輝度電子源を目指し, F-N プロットを用いた電子 源材料探索を行ってきたが,算出された仕事関数 が低いにも関わらず,想定したほどの放射電流が 得られない材料があった.そこで,F-N プロット 以外の有用な電子源評価方法として,F-N プロッ トの直線の傾き成分だけでなく,切片成分も利用 する S-K (Seppen-Katamuki) チャートの導入を考 えた. [3]

本研究では、仕事関数が既知である ZrO/W(100) 電子源、及び、修飾前のタングステン電子源について、S-K チャートを用いると結果にどのような 差異が現れるか調査し、比較検討を行ったので報 告する.

2 実験

2.1 電子源の作製

電子源材料の作製には、市販のタングステン 多結晶線材(直径 0.15mm)を用いた.図1(a) に作製したタングステン電子源を示す.電子源 先端は電解研磨によって曲率半径0.1µm程度の 鋭い針状に加工した.図1(b)にZrO/W(100)電子 源を示す.ZrO/W(100)電子源は、タングステン 電子源のシャフトの部分に酸化ジルコニウム 粉末をコロジオン溶液に溶いて塗布すること で作製した.



図 1. タングステン電子源

2.2 電界放射実験



図2に電界放射実験装置を示す.実験手順は以下 のとおりである.

- 作製した電子源材料を、チャンバー内へセットし、チャンバー内の排気とベークを行い、10⁻⁷Paオーダの超高真空とする.
- ② 超高真空中で、電子源材料を通電加熱する. 初めに、電子源が白熱する温度(2200 K) で 10 秒程度のフラッシングにより電子放 射面を清浄化する. ZrO/W(100)試料の場合 は、この後 1800 K で数分間通電加熱を続け、 電子源シャフトに塗布した酸化ジルコニウ ムを試料針先まで熱拡散させる.
- ③ 電子源試料とそれに対向する電極(蛍光板)の間に数 kV の電圧 V を印加することで、電子源試料先端の電子放射面へ電界を集中させる.電界放射が起きると、蛍光板に電子放射像が映る.ZrO/W(100)試料の場合は、この像を確認することで熱拡散の進行具合が把握できる.ジルコニウム酸化物が十分拡散すると(100)面の仕事関数が低下し、電子放射が集中するため、放射像に変化が起きる.
- ④ 印加電圧 V を変えながら、そのときの放射
 電流 I を測定する.
- ⑤ 得られた*I-V*特性からF-Nプロットを描く. また,F-N プロットの切片と傾きよりS-K チャートを描く.
- ⑥ 電界放射実験後,電子源試料をチャンバーから取り出し,電子源の先端曲率半径を FE-SEMで測定する.
- 3 結果
- 3.1 F-N プロット



図 3. F-N プロット

図3にF-Nプロットの結果例を示す. 横軸に印加 電圧 Vの逆数, 縦軸に放射電流 Iを印加電圧 Vの二 乗で除したあと自然対数を取った値を示している. F-N プロットの傾きは, タングステン電子源で -33055, ZrO/W(100)電子源で-30379 である. それ ぞれ仕事関数を算出すると, タングステン電子源は 4.64 eV, ZrO/W(100)電子源は 2.69 eV となり, こ れらは文献値に近似した値であった. [4][5]

3.2 S-K チャート



図3で得られた一つのF-Nプロット(切片と傾き) が,S-Kチャート上での1点となる.図4にS-Kチ ャートの結果を示す.横軸にF-Nプロットの切片, 縦軸にF-Nプロットの傾きを示している.ここで, F-Nプロットでは測定結果を自然対数で計算して扱 っていたが,S-Kチャートでは慣例に従って結果を 常用対数へ変換して扱っている.タングステン電子 源とZrO/W(100)電子源では,S-Kチャート上へプ ロットされる領域が異なっていることが分かる.

4 考察

S-K チャート上において,測定点は通常,仕事関数の低い順に右上から現れるといわれている. そのため,今回の実験では仕事関数が 2.7 eVのZrO/W(100)電子源,4.6 eVのタングステン電子源の順に右上から現れると予測されるが,実際の測定結果ではタングステン電子源,ZrO/W(100)の順で右上から現れた.

ここで電界放射による特性測定では、タングステン, ZrO/W(100)の順に電界放射が始まるまでの加速 電圧が大きくなっている.つまり、電子が出難くなっている.この結果より、電子源として用いるとき はほかのパラメータの影響もあり、低仕事関数であ ることと電子の出やすさは必ずしもイコールにはな らないと考えられる.そして、S-K チャート上で右 上に現れるのは「電子放射しやすい電子源」である と考えられる.



図 5. ZrO/W(100)電子源の電子放射像



図 6. タングステン電子源の電子放射像

また、ZrO/W(100)電子源は電界放射の際、二つ の輝点が現れる.図5にZrO/W(100)の電界放射 像を示す.これは二つの(100)面の仕事関数が低下 しているためである.しかし、表面修飾を行って いないタングステン電子源の場合は四つの輝点が 現れる.図6にタングステン電子源の電界放射像 を示す.ここでは図5と違い、四つの輝点がみら れている.これは二つの(111)面と、二つの(100) 面周辺からの電子放射像である.F-Nプロットの 切片には電子放射面積が含まれている.輝点数が 変わると、電子放射面積が変わるため、その違い もS-Kチャートの結果に影響を及ぼしていると考 えられる.

5 結論

本研究では、電界放射電子源の評価方法の一つ であるS-Kチャートの金属の違いによる差異を確 認することを目的とした.

複数個のタングステン電子源,及び, ZrO/W(100)電子源を作製し,電界放射実験を行なった.測定した放射電流 Iと印加電圧 Vの関係を F-Nプロット及びS-Kチャート上にプロットした. 実験結果より, F-N プロットから求めたタングス テン電子源の仕事関数は 4.64 eV, ZrO/W(100)電 子源の仕事関数は 2.69 eV となり,それぞれ文献 値に近似した値が得られた.

S-K チャート上では電子源の種類によってプロ ット点の現れる範囲が異なった.また,S-K チャ ート上では通常は仕事関数の低い順にプロット点 が右上から現れるとされているが,実際の測定結 果では印加電圧の低い順,つまり電子の出やすい 順に右上からW,ZrO/Wの順で現れた.この結 果より,S-K チャート上では「電子放射しやすい 電子源ごは電界放射の際,輝点が二つ現れるが, 表面修飾していないタングステン電子源の場合は 輝点が四つ現れる.F-N プロットの切片には電子 放射面積が含まれているため,この電子放射面積 の違いがS-Kチャートの結果に影響していると考 えられる.

今後の課題として,ジルコニウム酸化物以外で 表面修飾したタングステン電子源を作製し,S-K チャート上で差異を確認することが挙げられる.

参考文献

[1] 川久保貴史,中根英章,Ⅲ族酸化物で修飾したW(100)面からの電子放射—Sc酸化物,Pr酸化物,Nd酸化物による仕事関数低下現象—,信学技報,Vol. 116, no. 268, ED2016-52, pp. 41-46, 2016
[2] 佐藤慎也,中根英章,安達洋,二酸化ジル

コニウム熱拡散によるモリブデン(100)面から の電界放射の優勢化,真空, Vol. 47, No. 3, pp.51-54, 2004

[3] 西田 和史, 岩津 文夫, 森川 浩志, 局所電 流を用いた Seppen-Katamuki チャート, 真空, Vol.48, No.3, pp.115-117, 2005

[4] 走查電子顕微鏡, 日本電子顕微鏡学会関東 支部編, pp.5-6, 2008

[5] 大西亮, 川久保貴史, モリブデンおよびタ ングステン電界放射電子源の SK チャートによ る評価, The 19th IEEE Hiroshima Section Student Symposium, 2017